PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-236217

(43)Date of publication of application: 25.08.1992

(51)Int.CI.

C08G 59/42 C08K 9/04 C08L 63/00 H01L 23/29 H01L 23/31

(21)Application number: 03-014874

(71)Applicant: SHIN ETSU CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

14.01.1991

(72)Inventor: SHIOBARA TOSHIO

FUTATSUMORI KOJI ARAI KAZUHIRO

(54) LIGHT TRANSMITTING EPOXY RESIN COMPOSITION AND OPTICAL SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject composition, comprising a compound containing plural epoxy groups, an acid anhydride-based curing agent and a specific filler and excellent in transparency, low stress properties, crack resistance and mechanical characteristics.

CONSTITUTION: The objective composition comprising (A) a compound such as bisphenol type epoxy resin having two or more epoxy groups in one molecule, (B) an acid anhydride-based curing agent such as methylhexahydrophthalic anhydride [used in an amount of preferably 10–150 pts.wt. based on 100 pts.wt. component (A)] and (C) a filler such as silica, alumina or silicatiania glass particles prepared by treating the surface of a filler having substantially the same refractive index as that of a cured product of the components (A) and (B) with a surface treating agent composed of a compound having two or more epoxy groups in one molecule and/or an acid anhydride-based curing agent and an organosilicon compound such as a polysiloxane [used in an amount of preferably 100–300 pts.wt. based on 100 pts.wt. total amount of the components (A) and (B)]. Furthermore, an optical semiconductor device excellent in functional properties is obtained by sealing with the aforementioned composition.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-236217

(43)公開日 平成4年(1992)8月25日

(51) Int.Cl. ⁵ C 0 8 G 59/42 C 0 8 K 9/04	酸別配号 NHY	庁内整理番号 8416-4 J	FI	技術表示箇所
C08L 63/00 H01L 23/29	NLD	8416-4 J		
		8617—4M	H01L 審査請求 未請才	23/30 F R 請求項の数 2 (全 12 頁) 最終頁に続く
(21)出題番号	特顯平3-14874		(71) 出願人	000002080 信越化学工業株式会社
(22) 出顧日	平成3年(1991)1	月14日	(72)発明者	東京都千代田区大手町2丁目6番1号 塩原 利夫 群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化 学工業株式会社シリコーン電子材料技術研 究所内
				二ツ森 浩二 群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化 学工業株式会社シリコーン電子材料技術研 究所内
			(74)代理人	弁理士 小島 隆司 最終頁に続く

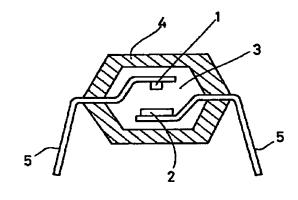
(54) 【発明の名称】 光透過性エポキシ樹脂組成物及び光半導体装置

(57)【要約】

【目的】 透明性に優れ、かつ低応力性で耐クラック性 の良好な光透過性エポキシ樹脂組成物を提供する。

【構成】 光透過性エポキシ樹脂組成物の主成分とし て、

- (A) ピスフェノール型エポキシ樹脂等の一分子中にエ ポキシ基を2個以上有する化合物、
- (B) メチルヘキサヒドロ無水フタル酸等の酸無水物系 硬化剤、
- (C) 前記(A) 成分と(B) 成分との硬化物と屈折率 が実質的に同じ充填剤、例えばシリカーチタニアガラス 粒子を、一分子中にエポキシ基を2個以上有する化合物 及び/又は酸無水物系硬化剤とシラン類等の有機ケイ素 化合物とからなる表面処理剤で表面処理した充填剤を含 有する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 一分子中にエポキシ基を2個以上 有する化合物、

(B) 酸無水物系硬化剂、

(C) 前記(A) 成分と(B) 成分との硬化物と屈折率が実質的に同じ充填剤を、一分子中にエポキシ基を2個以上有する化合物及び/又は酸無水物系硬化剤と有機ケイ素化合物とからなる表面処理剤で表面処理した充填剤を含有してなることを特徴とする光透過性エポキシ樹脂組成物。

【請求項2】 請求項1記載の光透過性エポキシ樹脂組成物で封止された光半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LED、CCD、フォトカプラーなど、光信号の授受によって機能する半導体の封止用として好適に用いられる光透過性エポキシ樹脂組成物及び該エポキシ樹脂組成物の硬化物で封止された光半導体装置に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来、 エポキシ樹脂は電気特性、耐湿性、耐熱性などに優れる 樹脂として知られ、特に酸無水物硬化タイプのエポキシ 樹脂組成物が透明性に優れていることから光半導体の封 止に繁用されている。

【0003】一方、エポキシ樹脂組成物には線膨張係数 を低下させて低応力化を図る手段としてシリカなどの無 機質充填剤を配合することが一般的に行なわれている。

【0004】しかし、このようにシリカ等の無機實充填剤を配合したエポキシ樹脂組成物から得られる硬化物は、エポキシ樹脂自体が透明で、かつ充填剤も透明であっても、不透明となってしまう。これは、エポキシ樹脂硬化物の25℃における屈折率n。は1、5~1、7程度であり、充填剤の屈折率(例えばSIO2の25℃における屈折率n。与1、458)との差が光散乱の原因となるからである。従って、エポキシ樹脂成分の硬化物の屈折率に近似した屈折率を有する充填剤を配合することにより、硬化物の透明性が得られることになる。

【0005】ところが、本発明者の検討によると、実際に屈折率の近似した硬化物を与えるエポキシ樹脂成分と充填剤とを配合すると、充填剤粒子に対するエポキシ樹脂成分のぬれ性が不十分なため、両者の界面にわずかな空隙や剥離が存在し、それが原因となって光散乱を起こしてしまい、本来得られるはずの透明性が得られないという問題を生じた。この場合、ぬれ性の改善のために充填剤をシランカップリング剤などで表面処理することは従来から行なわれ、この表面処理法は透明性とともに曲げ強さなどの機械的特性も向上するので、有効な手段であるといえる。しかし、後述する比較例からもわかるようにシランカップリング剤で処理した新貨剤を配合して

も得られるエポキシ樹脂組成物の硬化物の透明性は十分 ではなく、光半導体封止用として好適とは言い難かっ た。

【0006】本発明は上記事情に鑑みなされたもので、透明性に優れ、かつ、低応力性で機械的強度に優れた硬化物を与える光透過性エポキシ樹脂組成物、及び、この光透過性エポキシ樹脂組成物で封止された光半導体装置を提供することを目的とする。

[0007]

10 【課題を解決するための手段及び作用】本発明者は上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結果、一分子中にエボキシ基を2個以上有する化合物と酸無水物系硬化剤とをエボキシ樹脂成分として含有するエボキシ樹脂組成物に、前配エボキシ樹脂成分の硬化物と屈折率が実質的に同じ充填剤を一分子中にエボキシ基を2個以上有する化合物及び/又は酸無水物系硬化剤と有機ケイ素化合物とからなる表面処理剤で表面処理したものを配合した場合、かかるエボキシ樹脂成分と表面処理済充填剤との間のぬれ性が著しく改善されて界面の密着性が高まる上、20 両者の屈折率差も実質的にないことから、光散乱が大幅

四者の屈折率差も実質的にないことから、光散乱が大幅 に減少し、それ故、透明性に優れていると共に、低応力 性で耐クラック性が良好な機械的強度に優れた硬化物を 与える光透過性エポキシ樹脂組成物が得られ、かかるエ ポキシ樹脂組成物の硬化物で封止された光半導体装置は 従来の光透過性エポキシ樹脂で封止されたものに比較し てはるかにその機能を有効に発揮することを見い出し、 本発明をなすに至ったものである。

【0008】従って、本発明は、

- (A) 一分子中にエポキシ基を2個以上有する化合物、
- (B) 酸無水物系硬化剂、

(C) 前記(A) 成分と(B) 成分との硬化物と屈折率が実質的に同じ充填剤を、一分子中にエポキシ基を2個以上有する化合物及び/又は酸無水物系硬化剤と有機ケイ素化合物とからなる表面処理剤で表面処理した充填剤を含有してなる光透過性エポキシ樹脂組成物、及び、この光透過性エポキシ樹脂組成物で封止された光半導体装置を提供する。

【0009】以下、本発明について更に詳しく説明すると、本発明の光透過性エボキシ樹脂組成物を構成する(A)成分の1分子中にエボキシ基を2個以上有する化合物としては、従来より知られている種々のエボキシ樹脂が液状、固体状を問わず使用できる。具体的にはエピクロルヒドリンとピスフェノールをはじめとする各種ノボラック樹脂から合成されるエボキシ樹脂、脂環式エボキシ樹脂あるいは塩素や臭素原子等のハロゲン原子を導入したエボキシ樹脂などを挙げることができ、これらの1種を単独で又は2種以上を併用して使用することができる。

あるといえる。しかし、後述する比較例からもわかるよ 【0010】これらの中では特に着色の少ないピスフェ うにシランカップリング剤で処理した充填剤を配合して *50* ノール型エポキシ樹脂が好ましく、例えば具体的な商品

としてはエピコート828、エピコート1001、エピ コート1004 (以上油化シェルエポキシ社製、商品 名)、RE310S、RE304S(以上日本化築社 製, 商品名)、DER332、DER661、DER6 64 (以上ダウケミカル社製、商品名) 等を挙げること ができる。

【0011】また、(B)成分の酸無水物系硬化剤とし ては、通常エポキシ樹脂の硬化に用いられるものならい ずれのものも使用でき、例えばメチルヘキサヒドロ無水 フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、テトラヒドロ無 10 水フタル酸、無水フタル酸、無水トリメリット酸、無水 ピロメリット酸等が挙げられるが、中でもヘキサヒドロ 無水フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸等の芳香環を 含まないものが好適である。なお、酸無水物系硬化剤の 配合量は通常量とすることができるが、(A)成分10 0 重量部に対して10~150重量部とすることが好ま しい。

【0012】本発明のエポキシ樹脂組成物においては、

(C) 成分として一分子中にエポキシ基を2個以上有す る化合物及び/又は酸無水物系硬化剤と有機ケイ素化合 20 物とからなる表面処理剤で処理した充填剤を配合する。

◆【0013】ここで、充填剤としては、何えばシリカ、 アルミナ、窒化アルミ、窒化ホウ素、シリカーチタニア ガラス、シリカーアルミナガラスなどが使用できるが、 特にシリカーチタニアガラスはSIOz/TIOzの組成 を変えることにより、充填剤の25℃における屈折率n 0.を調整できるため、有効であり好ましい。

【0014】更に、シリカーチタニアガラス粒子として は、下配直線透過率測定方法Mによる900nmから6 00nmの波長範囲で直線透過率が70%以上、特に8 0%以上のものを好適に使用することができる。

【0015】M:下配の一般式(1)で示されるピスフ ェノール型エポキシ樹脂又は下配の一般式 (2) で示さ れるノボラック型エポキシ樹脂とフェニルグリシジルエ ーテルとを混合し、シリカーチタニアガラス粒子との屈 折率差が±0.002以内になる溶液を調製する。この 溶液と平均粒径が5~30μmに粉砕されたシリカーチ タニアガラス粒子とを重量比で1:1に混合し、その混 合物について1mmの光路長で直線透過率を測定する。

[0016]

(化1)

(但し、式中nは0~10の整数である。)

(但し、nは0~10の整数である。)

【0017】 このような高透明性のシリカーチタニアガ 40 が好ましい。 T1O2の含有量が10モル%に達しない ラス粒子を製造する方法は、先に本出願人が提案した特 顧平2-028077号記載のゾルゲル法に準じて行な うことができる。

【0018】即ち、まず出発原料として、Si (OCH s) 1, S 1 (OC2 H5) 1などのようなシリコンアルコ キシドとTi(OCaHr), Ti(OCaHa),などの ようなチタンアルコキシドとを用いる。

【0019】この場合、T102をS102とT102と の合計に対して10~18モル%となるような量でシリ コンアルコキシドとチタンアルコキシドとを用いること 50 プロパノールなどのようなアルコールに溶解し、これに

と得られるシリカーチタニアガラス粒子の屈折率がエボ キシ樹脂の充填剤として好ましいとされる1.53以上 とすることができない場合があり、一方18モル%を超 えると、このようなシリカーチタニアガラス粒子の屈折 率に等しい透明なエポキシ樹脂を得るのが困難となる場 合がある。

【0020】これらの原料からゾル、ゲルを得る方法と しては、上記シリコンアルコキシドとチタンアルコキシ ドとを希釈用の溶媒としてのメタノール、エタノール、

水を加えて加水分解させてシリカーチタニアプルを作っ たのち、このゾルをゲル化用の容器に移し、密閉状態に してから恒温乾燥器中に静置させてゲル化させる方法が 好適に採用される。この場合、このゲル化温度およびゲ ル化後の熟成温度については、これを60℃より低くす るとアルコキシドの加水分解が不完全なものとなる場合 があり、後配する焼結工程で着色の原因となる3価のT iイオンが発生し易くなるので、このゲル化及び熟成の 温度は60℃以上とすることが好ましい。なお、熱成 は、この加水分解を完全なものとする点から1時間以 10 い。なお、焼結時間は上記温度範囲で通常 $10\sim300$ 上、好ましくは5時間以上とすることがよい。

【0021】次に、上配ゲル化、熟成の終了した過式ゲ ルの乾燥方法としては特に制限されないが、例えばゲル を熟成することに用いた密閉容器の査を取り、そのまま 恒温乾燥器中に放置して乾燥し、乾燥ゲルを得る方法を 採用することができる。

【0022】更に、このようにして得られた乾燥ゲルを 粉砕した後に焼結する。ここで、粉砕方法は特に制限さ れず、また粒径も適宜選定され、用途に応じた適当な粉 m、特に5~30 µmとすることが好ましい。。

【0023】最後に粉砕した乾燥ゲルを焼結ガラス化す るが、この焼結温度を1050~1250℃の範囲で行 なうことが好ましい。焼結温度が1050℃未満では粒 子が完全に均一に穀密化せず、従ってこのシリカーチタ ニアガラス粒子の透過率を測定した場合、粒子内部に入 射した光は、シリカーチタニアガラス構成粒子とその構 成粒子間隙の空孔との間の屈折率差により散乱されるた め、その結果として低い透過率値しか得ることができな い場合がある。また、焼結温度が1250℃よりも高い 30 温度では、TiO:の結晶相の1つであるAnatas e 相の析出が起こるため、この温度範囲でも同様に光透

過性に優れるシリカーチタニアガラス粒子は得られない 場合がある。

【0024】なお、この焼結方法は、上記温度範囲内で あればよく、特に制限されないが、電気炉等の一定温度 に保つ焼結炉を使用し、炉中に空気、酸素ガス又は酸素 と空気との混合ガスを送入して炉内を酸化性雰囲気とす ることが着色の原因となる3個のT1イオン発生を防止 する上で好ましい。また、所定の温度に達するまでの昇 温速度は通常10~500℃/時間とすることが好まし 分である。

【0025】なお、本発明では、上述したシリカーチタ ニアガラス粒子等の充填剤は、エポキシ樹脂に配合した 場合の光散乱を最小限にするため、(A)成分及び (B) 成分からなるエポキシ樹脂成分の硬化物の屈折率 と実質的に同じであることが必要である。具体的には、 屈折率差が±0.01以内、好ましくは±0.005以 内、更に好ましくは±0.002以下とする。

【0026】更に、上記充填剤の表面処理剤として使用 砕方法、粒径を採用し得るが、平均粒径 $1\sim 1$ 00 μ 20 する一分子中にエポキシ基を 2 個以上有する化合物及び 酸無水物系硬化剤としては、本発明組成物にそれぞれ (A) 成分及び(B) 成分として配合し得る化合物を使 用することができるが、(A)成分及び(B)成分と同 一の化合物を用いても、異なった化合物を用いてもよ

> 【0027】また、表面処理剤としての有機ケイ素化合 物としては、次式に示されるようなシラン類及びオルガ ノポリシロキサンを代表的なものとして挙げることがで き、これらの1種を単独で又は2種以上を併用して用い ることができる。

[0028] [化2]

CH2CHCH2OCH2CH2CH2Si(OCH3)3

CH2CHCH2(CH2), CH2Si(OCH2)

(n=1~10の整数)

Si(OCH₀)₄ .

Si(OCH2CH3)4 .

CH-Si(OCH)

HSCH2CH2CH2Si(OCH3)3

NH2CH2CH2CH2Si(OCH2)2

NH2CH2CH2NHCH2CH2CH2Si(OCH9)8

HD
$$\begin{pmatrix} CH_g \\ -SiO \end{pmatrix}$$
 H . $CH_gO \begin{pmatrix} CH_3 \\ -SiO \end{pmatrix}$ $CH_g \quad (n=1\sim100)$

$$HO = \begin{pmatrix} \bigcirc \\ SIO \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CH_8 \\ SIO \end{pmatrix} H \cdot CH_9O = \begin{pmatrix} \bigcirc \\ SIO \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CH_8 \\ SIO \end{pmatrix} CH_9$$

(n.m=l~10の整数であり、n+m≤10)

【0029】本発明において、表面処理剤としての上記 3成分の配合割合は、1分子中にエポキシ基を2個以上 有する化合物を(a)、酸無水物系硬化剤を(b)、有 機ケイ素化合物を(c)とした時、

- i) 処理剤として(a)と(c)の混合物を用いる場合
- (a) / (c) = 50/50~99/1
- 11) 処理剤として(b)と(c)の混合物を用いる場
- (b) / (c) = 50/50~99/1
- を用いる場合
- (a) / (b) = 50/50~85/15でかつ $((a) + (b))/(c) = 50/50\sim99/1$ (いずれも重量比) とすることが好ましい。
- 【0030】なお、本発明では上記3成分からなる表面 処理剤と充填剤の屈折率は近似していることが好まし く、両者の屈折率差が±0.1以内、特に±0.05以 内であることが望ましいもので、このような屈折率にな るように調整することが好ましい。

は、乾式法又は湿式法によって行なうことができる。乾 式法としては公知の手段を採用し得、例えば高速回転で 剪断力が大きく加温装置を有する高速ミキサーに充填剤 を入れ、溶剤で希釈した表面処理剤をスプレーなどによ り添加して混合撹拌を行なう工業的に一般化している方 法を採用し得る。一方、湿式法としては、充填剤、表面 処理剤及び溶剤を混合撹拌した後、溶剤を除去する常法 手法が採用できる。

【0032】この場合、溶剤の種類については特に限定 1 1 i) 処理剤として(a) と(b) と(c) の混合物 40 されないが、表面処理剤の充填剤への吸着性に違いが現 れるため、適宜選定することが望ましいが、具体的には トルエン、メチルエチルケトン、メチルイソプチルケト ン等を好適に用いることができる。また、溶剤除去後、 100~600℃で加熱することも有効である。

> 【0033】なお、上配表面処理剤の充填剤に対する配 合量(付着量)は、充填剤100重量部に対して表面処 理剤を0.1~5重量部、特に0.5~2重量部とする ことができる。

【0034】このように表面処理した充填剤の配合量 【0031】上記表面処理剤による充填剤の表面処理 50 は、エポキシ樹脂成分としての(A)成分及び(B)成

分の合計量100重量部に対して10~600重量部、 特に100~300重量部とすることが好ましく、10 重量部未満の配合では低収縮率、低膨張性付与効果が十 分現れない場合があり、一方600重量部を超えて配合 すると組成物の粘度が高くなりすぎてしまう場合があ る.

【0035】更に、本発明においては、上記した (A) 成分と(B)成分の反応を促進させる目的で硬化促進剤 を任意に配合することが好ましい。硬化促進剤として は、例えばイミダゾールあるいはその誘導体として2-エチルー4ーメチルイミダゾール、2ーフェニルイミダ ソール、1ーシアノエチルー2ーメチルイミダゾールな ど、また三級アミン誘導体として1、8-ジアザービシ クロ(5.4.0) ウンデセン-7 (DBU)、ペンジ ルジメチルアミンなど、ホスフィン系誘導体としてトリ フェニルホスフィン、ノニル・ジフェニルホスフィンな どを挙げることができる。なお、硬化促進剤の配合量は 通常用いられる量とすればよいが、(A)。(B) 両成 分の合計100重量部に対して10重量部以下、特に 0. 1~10重量部が好適である。

【0036】本発明においては、任意成分として変色防 止剤を加えてもよい。変色防止剤としては、例えば農元 性有機リン化合物として亜リン酸トリフェニル、亜リン 酸トリデシル、亜リン酸ノニル・ジフェニル、9, 10 ージヒドロー9ーオキサー10-フォスファフェナンス レン、9、10-ジヒドロ-9-オキサ-10-フォス ファフェナンスレン-10-オキサイドなど、ヒンダー ドフェノール類として2, 6-ジ-t-プチル-4-メ チルフェノール (BHT)、2,4,6-トリシクロへ キシルフェノール、2,4,6-トリペンジルフェノー 30 ルなど、チオエーテル系化合物としてはジラウリルー 3, 3'ーチオジプロピオネート、ジトリデシルー3, 3'ーチオジプロピオネート、〔4, 4'ーチオピス (3-メチル-6-tert-プチルフェニル)) - ビ ス(アルキルチオプロピオネート)などが挙げられ、こ れらの1種を単独で、又は2種以上を併用して使用する ことができる。この変色防止剤の配合量も通常量とする ことができるが、(A), (B) 両成分の合計量100 重量部に対して0.1~10重量部が好ましい。

も任意成分として各種の添加剤を本発明の効果を妨げな い範囲で添加することができ、任意成分として具体的に は、各種の硬化促進剤、低応力化剤、離型剤、可視光力 ット剤、難燃化剤などを適宜配合することができる。

【0038】本発明の光透過性エポキシ樹脂組成物を製 造する場合、上述した成分の所定量を均一に撹拌、混合 して得ることができるが、この際、各種のミキサー、ニ ーダー、ロール、エクストルーダーなどを使用して行な うことができる。なお、成分の配合順序に特に制限はな 63.

【0039】本発明の組成物は、樹脂成分の性状にかか わらず光半導体の封止用として好適に使用でき、室温で 液状ならばポッティング法、キャスティング法などの成 形法、室温で固形ならばトランスファー成形、インジェ クション成形を採用することができる。この場合、成形 塩度は80~160℃、ポストキュアーは140~16 0℃で2~16時間行なうことが好ましい。なお、本発 明組成物の使用に際し、高透明性を発揮させるために、 エポキシ樹脂組成物の一部又は全部が固形であるとき 10 は、必要とする全成分又はその一部と予め加熱溶融して から混合することが効果的であり、あるいは溶媒中に溶 解してから均一に混合し、次いで溶剤をストリップする

10

[0040]

方法も採用し得る。

【実施例】以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具 体的に説明するが、本発明は下配の実施例に制限される ものではない。なお、以下の例において部はいずれも重 量部である。また、各例に先立ち、各例で使用した表面 処理された充填剤の製造例を示す。

【0041】 (製造例)

(充填剤の製造)

先に本出願人が提案した特願平2-8077号記載のゾ ルゲル法に準じ、下記方法で高透明性のシリカーチタニ アガラス粒子を製造した。シリカーチタニアガラス粒子 — I

テトラメトキシシラン(商品名KBM04、信越化学工 業社製) 1522. 2gとメタノール (和光純薬工業社 製、特製)320.4gの溶液に0.2規定塩酸水溶液 180m1を30℃で15分かけて滴下した後、30℃ で1時間撹拌した。次いで、テトラノルマルプチルチタ ネート (日本曹達社製) 513. 5gとメタノール16 0.2gの溶液を30℃で1時間かけて滴下し、30℃ で1時間撹拌した後、純水648.6gを30℃で15 分間かけて滴下し、更に30℃で10分間撹拌した。

【0042】得られたシリカーチタニアゾルをポリプロ ピレン製容器に入れ90℃で密閉したところ、ゾルは約 30分後にゲル化した。このゲルをそのまま60℃密閉 で12時間熱成した後、容器の蓋を除き、90℃の乾燥 機で3日間乾燥して、乾燥ゲル体を得た。これをアルミ [0037]なお、本発明組成物には、上配成分以外に 40 ナ製のボールミルで粉砕し、粉砕後の乾燥ゲル体を箱型 電気炉に入れ、500℃まではN:1.4m³/h、50 0℃からはドライエアー14m³/hの条件で1100 ℃まで13時間かけて昇温し、1100℃で30分間保 持したところ、表1に示す屈折率、光透過率及び平均粒 径を有するシリカーチタニアガラス粒子が得られた。

【0043】シリカーチタニアガラス粒子-11 シリカーチタニアガラス粒子-Iの処方に準じ、テトラ メトキシシラン1522、2gとメタノール320、4 gの溶液、0.2規定塩酸水溶液180m1、テトラノ 50 ルマルプチルチタネート675.0gとメタノール16

0. 2gの溶液、純水682.8gより、上述の製法と 同じ条件でゾルを調製、熟成、乾燥、焼結を行なったと ころ、表1に示す屈折率、光透過率及び平均粒径を有す* **⇒るシリカーチタニアガラス粒子ーⅠⅠが得られた。** [0044] 【弗1】

12

	-	シリカーチタニア ガ ラ ス 粒 子 - I	シリカーチタニア ガラス粒子 - Ⅱ				
25℃における屈折率 n。		1.5430	1.5708				
	700nm	85.3	87.9				
光透過率 (%)	589nm	83.1	84.8				
	500mm	67.8	68.0				
平均粒	径 (µ m)	10.0	9.8				

【0045】この場合、屈折率、光透過率及び平均粒径 は下記の方法により測定した。

屈折率の測定方法

アタゴ社製アッペ屈折計3 Tにて測定した。

光透過率の測定方法

平均粒径5~30μmのTiO₁-SiO₁粒子を、Ti 20 <u>充填剤b</u> O:の含有量から計算される屈折率に±0.002の範 囲になるように混合比を調整したエピコート828(油 化シェルエポキシ社製エポキシ樹脂) とフェニルグリシ ジルエーテルとの混合液 (浸液) に、重量比で1:1に なるように混合した。十分に粒子を分散させた後、目視 で泡が観察されなくなるまで減圧脱気を行なった。この 混合物を1mmの光路長を有するセルに入れ、分光光度 計を用いて900nmから400nmの被長範囲で透過 本スペクトルを測定した。この場合、レファランスはプ ランクである。なお、シリカーチタニアガラス粒子-I 30 充填剤 a と同一の装置を使用し、シリカーチタニアガラ 及びIIに対してはそれぞれ25℃における屈折率n。 =1. 5248と1. 5705の混合液を調製し、浸液 として測定に使用した。

粒度分布の測定方法

試料の分散媒としてヘキサメタリン酸ソーダの0.2重 量%の水溶液を使用し、島津製造心沈降式粒度分布測定 装置SA-CP3Lにて測定した粒度分布を測定し、平 均粒径を求めた。

【0046】 (充填剤の表面処理)

充填剤a

リフラックスコンデンサー、温度計、撹拌機、エステル アダプター及び海下ロートを具備した内容積1リットル の四つロフラスコにシリカーチタニアガラス粒子-- I を 200gとトルエン500gを入れ、遺流温度で撹拌し ながら1時間共沸脱水を行なった。これにエポキシ化ビ スフェノールA-I (商品名:エピコート828、油化 シェルエポキシ社製) 1.93g、アーグリシドキシブ ロピルトリメトキシシラン(商品名:KBM403、信 越化学工業社製) 0. 47g、1,8-ジアザビシクロ

0.02g、トルエン20gよりなる表面処理剤溶液を 滴下時間5分にて滴下した後、更に湿流温度で4時間撹 弁を続けた。この反応混合液中の溶剤を減圧下に留去 し、温度120℃で12時間乾燥させて表面処理された 充填剤aを得た。

充填剤aと同一の装置を使用し、シリカーチタニアガラ ス粒子-Iの200gをエポキシ化ピスフェノールA-Iを1.27g、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸(商 品名:リカシッドMH-700、新日本理化社製)を 1. 12g、ャーグリシドキシプロピルトリメトキシシ ランを0.01g、DBUを0.02g、トルエンを2 0 g混合してなる表面処理剤溶液で充填剤 a と同様の条 件で処理し、充填剤bを得た。

充填剤c

ス粒子- I Iの200gをエポキシ化ピスフェノールA - I I (商品名:エピコート1001、油化シェルエボ キシ社製) 1.93g、ァーグリシドキシプロピルトリ メトキシシラン0.47g、DBU0.02g、トルエ ン20gよりなる表面処理剤溶液で充填剤aと同様の条 件で処理し、充填剤cを得た。

充填剤d

充填剤aと同一の装置を使用し、シリカーチタニアガラ ス粒子-IIの200gをエポキシ化ピスフェノールA - I I を 1. 2 7 g、ヘキサヒドロ無水フタル酸(商品 名:リカシッドHH、新日本理化社製) 1. 12g、7 -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン0.01 g、DBU0. 02g、トルエン20gよりなる表面処 理剤溶液で充填剤aと同様の条件で処理し、充填剤dを 得た。

充填剤 e, f, g, h

ァーグリシドキシプロピルトリメトキシシランの代わり にテトラメトキシシラン(商品名:KBM04、信越化 学工業社製)を使用する以外は充填剤a,b,c,dと (5.4.0) ウンデセンー 7 (以下DBUと略す) 50 同様の処理を行ない、それぞれ充填剤 e , f , g , h を 1.3

得た。

充填剤i,j

充填剤 a と同一の装置を使用し、シリカーチタニアガラ ス粒子-「及びIIの200gずつをィーグリシドキシ プロピルトリメトキシシラン2. 4g、DBU0.02 g、トルエン20gよりなる表面処理剤溶液で充填剤a と同様の条件で処理し、それぞれ充填剤i,jを得た。 <u> 充填剤 k,m</u>ァーグリシドキシプロピルトリメトキシシ ランの代わりにテトラメトキシシラ

い、それぞれ充填剤k,mを得た。

[0047] [実施例、比較例]

(実施例1, 2, 5, 6、比較例1, 3, 5)

ピスフェノールA型エポキシ樹脂-I (商品名:エピコ ート828、エポキシ当量190、室温で液状、油化シ エルエポキシ社製) 53.1部、メチルヘキサヒドロ無 水フタル酸(商品名:リカシッドMH-700、室温で 液状、新日本理化社製)46.9部、2-エチル-4-メチルイミダゾール(商品名:キュアゾール2E4M (和光純菜工業社製) 2部、アーグリシドキシブロビル トリメトキシシラン(商品名: KBM403、信越化学 工業社製) 0. 6部からなる樹脂成分にそれぞれ表面処 理を施した充填剤 a, b, e, f, l, k又は非処理の シリカーチタニアガラス粒子-Iを100部を配合し、 ミキサーを使用して減圧脱気を行ないながら室温で30*

14 *分間撹拌混合し、室温で液状の7種の光透過性エポキシ 樹脂組成物を作成した。

[0048] (実施例3, 4, 7, 8、比較例2, 4, 6) ビスフェノールA型エポキシ樹脂-II(商品名: エピコート1001、エポキシ当量475、軟化点64 ℃、油化シェルエポキシ社製) 75.5部、ヘキサヒド 口無水フタル酸(商品名:リカシッドHH、融点36 ℃、新日本理化社製)24.5部、亜リン酸トリフェニ ル2部及びァーグリシドキシブロピルトリメトキシシラ ンを使用する以外は充填剤1, j と同様の処理を行な 10 ン0.6部からなる樹脂成分にそれぞれ表面処理を施し た充填剤 c, d, g, h, j, m又は非処理のシリカー チタニアガラス粒子- I I を100部配合し、ミキサー を使用して減圧脱気を行ないつつ70℃で15分間溶融 混合した後、2-エチル-4-メチルイミダゾール1部 を加え、再び減圧下70℃で5分間混合して、室温で固 形の7種の光透過性エポキシ樹脂組成物を作成した。

【0049】(比較例7,8)シリカーチタニアガラス 粒子-I又はIIの100部を配合しない以外はそれぞ れ比較例5又は6と同様の配合、製法でそれぞれ室温で Z、四国化成工業社製) 1 部、亜リン酸トリフェニル 20 液状又は固型の光透過性エポキシ樹脂組成物を作成し た。

> 【0050】次に、これらのエポキシ樹脂組成物につい て表2に示す成形条件、アフターキュアー条件により試 験片を作成し、下記の試験を行なった。

[0051] 【表2】

	啟	形 条 件		779-427-条件		
	温度	圧力	時間	温度	時間	
実施例1,2,5,6	100°C					
比較例1.3,5,7	100 C	- 4時間		150℃	4時間	
実施例3,4,7,8	1 = 0.00					
比較例 2,4,6,8	150℃	70 kg/cm²	5分間	150°C	4時間	

【0052】光透過率

10×50×1mmの試験片を作成し、吸光光度計を用 いて500, 589, 700nmの光透過率を測定し た.

ガラス転移温度、線膨張係数

5×5×15mmの試験片を作製し、ディラトメーター により毎分5℃の速さで昇温させて測定した。

耐クラック性

9. 0×4. 5×0. 5mmの大きさのシリコンチップ

を14PIN-ICフレーム (42アロイ) に接着し、 これをエポキシ樹脂組成物で表3~7に示した成形条 件、アフターキュアー条件で封止した後、-50℃×3 0分~150℃×30分の熱サイクルを繰り返して加 え、200サイクル後の樹脂クラック発生率を測定し た。以上の結果を表3~7に示す。

[0053]

【表3】

	15			•	,						16
				т—		<u></u>			AST		
1						史		<u>t</u>	<i>9</i> 4		
$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$				1	2	3	4	5	В	7	8
		キ シノール	化ピス	53.1	53.1	:		53.1	53.1		
		キ シ ソールA-	化 ビス - II			75.5	75.5			75. 5	75.5
		ルヘキ・ フタル	サヒドロ/酸	46.9	46.9			46.9	46.9		
配	へは無対		- ドロアル酸			24.5	24.5			24.5	24.5
合		チル- 4 ダソー	ーメチル ・ル	1	1	1	1	1	1	1	1
	亜リ	ン散トリ	フェニル	2	2	2	2	2	2	2	2
粗	•	リシドキ メ ト キ シ	シプロピル シラン	0.6	0.6	0.6	CB	0.6	0.8	0.5	0.8
成		充 填	剤a	100							
	処	"	ь		100						
		"	c			100					
		"	d	1			100				
	理			+	 			100	\vdash	\vdash	-
		"	f	\vdash					100		
	240	"							100	100	
	蒼		g	-	_					100	
Ш		"	h					L			100

[0054] 【表4】

30

17

-									
1						ᄲ	<u>ا</u> ا	校	例
L						1	2	3	4
			ドキミノール			53.1		53.1	
		フェ	ドキ シ ノールA	7 — II			75.5		76.5
ı	E	メチ無水	ルヘキ フタ	サヒル 酸	Fo	46.9		46.9	
	<u>.</u>		キ サ 水 フ				24.5		24.5
			チル- ダソ		・チル	1	1	1	1
*		亜リ	ン酸ト	リフェ	ニル	2	2	2	2
Ā	R		プシドキ メトキ :			0.6	0.8	0.8	0.6
		処	充填	剤	i	100			
		理	"		j		100		
		済	. "		k			100	
1	1	9 7	#		m				100

【0055】 【表5】

10

20

				実		地	例		
L		1	2	3	4	5	6	7	8
	光透過率 T % 500nm	75	78	67	73	74	777	68	72
44.	" 589nm	85	80	76	77	86	80	π	75
物	∕″ 700 <u>mm</u>	89	83	80	78	89	82	80	79
性	ガラス転移温度 (℃)	134	135	118	118	135	134	119	118
	線 影 强 係 数 (10 ⁻¹ / ⁻ C)	3.7	8.6	3.6	8.6	8.7	3.8	3.7	3.7
	耐クラック性 (%)	0	0	0	0	0	0	0	0

【0056】 【表6】

19									
		H	. 1	Ż	例				
		1	2	3	4				
	光透過率 T % 500mm	58	35	58	34				
	# 589nm	67	60	68	48				
钩	" 700nm	73	61	72	83				
性	ガラス転移温度 (℃)	133	117	132	118				
	線 膨 張 係 数 (10 ⁻¹ ∕*C)	8.7	3.8	8.8	9.7				
	耐クラック性 (%)	0	0	0	0				

*【0057】 【表7】

10

		此	比 •		例	
		5	6	7	8	
配	エポキシ化ビスフェノールA-I	53.1		53.1		
	エポキシ化ビスフェノール A - I		75.5		75.5	
	メチルヘキサヒドロ無水フタル酸	46.9		46.9		
合	ヘキサヒドロ無水フタル酸		24.5		24.5	
	2-エチル-4-メチルイミダソール	1	1	1	1	
組	亜リン酸トリフェニル	2	2	2	2	
	ァーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン	0.8	0.6	0.6	0.8	
	非処理シリカーチタニアガラス粒子O	100				
成	非処理シリカーチタニアガラス粒子②		100			
	光 通 道 率 T % 500mm	48	33	88	98	
物	″ 589nm	60	47	8	99	
וש	# 700nm	63	55	83	99	
惟	ガラス転移温度 (*C)	137	118	135	117	
Œ.	線 膨 張 係 数 (10-1/℃)	3.7	3.6	8.0	6.2	
	耐 ク ラ ッ ク 性 (%)	0	0	100	100	

【0058】表3~7の結果より、シリカーチタニアガラス粒子をシランーカップリング剤単独で表面処理して配合した場合(比較例1~4)、界面のぬれ性が若干改良され、光透過率は向上していたが、まだ不十分であった。更に、非処理のシリカーチタニアガラス粒子を配合した場合(比較例5,6)、線膨張係数が低下して耐クラック性が向上するものの、樹脂成分とシリカーチタニアガラス粒子との界面のぬれ性が悪いため、光透過率が低く、また、いずれの充填剤も配合しない場合(比較例7,8)、光透過率が高いものの、耐クラック性が悪かった。

【0059】これらに対し、本発明の光透過性エポキシ 50 ン含有のモールド成形した遮光性の樹脂、5はリード線

【0058】表3~7の結果より、シリカーチタニアガ 樹脂組成物(実施例1~8)は、樹脂成分と充填剤との ラス粒子をシランーカップリング剤単独で表面処理して 40 ぬれ性が更に改善されて光透過率が高く、しかも、充填配合した場合(比較例1~4)、界面のぬれ性が若干改 剤が配合されているために硬化物の線膨張係数が低く、 酸クラック性が良好であった。

【0060】〔実施例9〕実施例1と比較例1及び5の 光透過性エポキシ樹脂を用いてフォトカプラーを組み立 て、光結合効率を測定した。図面はそのフォトカプラー の縦断面図であり、1は発光素子(ガリウム・ヒ素発光 ダイオード)、2は受光素子(シリコン・フォトトラン ジスタ)、3はインナー樹脂で、エポキシ樹脂をモール ド成形した透光性の樹脂、4はアウター樹脂で、カーボ ン含有のチールド成形した速光性の樹脂。5はリード線

である。

【0061】この結果、インナー樹脂が実施例1の組成 物の硬化物である場合、比較例1及び5の組成物の硬化 物の場合と比較して光結合効率をそれぞれ1.3及び 1. 5倍とすることができた。

[0062]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の光透過性 エポキシ樹脂組成物は、上述したエポキシ樹脂成分の硬 化物と屈折率が近似した充填剤をエポキシ化合物及び/ 又は酸無水物系硬化剤と有機ケイ素化合物よりなる表面 10 2 受光素子 処理剤で処理した充填剤を配合したことにより、樹脂成 分と充填剤との間のぬれ性が良好であり、透明性が高 く、低収縮率、低膨張率で低応力性であり、機械的強度 に優れているため、光機能性及び信頼性に優れ、LE

D、CCD、フォトカプラー等の光半導体封止用に好適 に使用できる。また、本発明の光透過性エポキシ樹脂組 成物で封止された光半導体装置は、光機能性を有効に発 揮すると共に、信頼性に優れたものである。

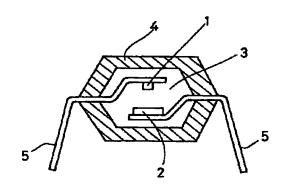
【図面の簡単な説明】

【図1】実施例で使用したフォトカプラーの縦断面図で ある。

【符号の説明】

- 1 発光素子
- 3 インナー樹脂
- 4 アウター樹脂
- 5 リード線

【図1】



フロントページの続き

(51) Iat. Cl. 5

識別記号 **庁内整理番号** FΙ

技術表示箇所

(72)発明者 新井 一弘

H01L 23/31

群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化 学工業株式会社シリコーン電子材料技術研 究所内